

LJ-18M 磁控离子溅射仪



LJ-18M 磁控离子溅射仪是由裕隆时代精心设计制造的新一代磁控镀膜系统。

- ▶ 配置平面磁控靶头，膜层均匀致密，大幅提升镀膜效率，降低样品表面温度。
- ▶ 特别适用于薄膜、生物等对热敏感样品镀膜、高分辨钨灯丝或场发射扫描电镜样品制备，及电极制作等领域。

- 配置高质量真空系统和微调阀，结合自动控制电路，预置工作真空和电流，无需反复调节，
- 操作极为简洁。可自选所需电离气体（氩气，空气），以获得最佳镀膜效果。
- 棱角成型工艺制成高强度真空玻璃罩，防止轻易磕碰损伤及边缘“崩边”。
- 标配Φ57mm X 0.12mm 大尺寸铂靶，溅射范围更大，靶材使用时间更长。
- 高级铝制机箱，机身小巧，坚实美观。模块化设计，便于安装及检修。

标准配置

型号		技术参数
1	LJ-18M	1.1 溅射靶头：平面磁控靶头 1.2 溅射电流：0-100mA 1.3 玻璃处理室：Φ 125mm x 130mm 1.4 试样台尺寸：Φ 40mm，可同时放 6 个样品台 1.5 靶材尺寸：Φ57mm X 0.12mm 1.6 真空系统：直联旋片真空泵，2L/S 1.7 真空保护：20Pa，配有微量气体调节阀控制工作真空 1.8 工作电源：220 VAC 50Hz 1.9 定时开关：控制溅射时间，范围 10~110S。 1.9 可用靶材：铂靶（标准配置），金靶，铜靶，银靶等 1.10 工作气体：空气或氩气

裕隆时代，您最好的选择！

欢迎登陆企业网站 www.ylcorp.com.cn，或拨打电话 010-6236 9061，以了解更多仪器信息！